

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 6 月 2 日 (02.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/050680 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01G 7/02, H04R 19/01  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016835  
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 12 日 (12.11.2004)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ:  
特願 2003-390554

2003 年 11 月 20 日 (20.11.2003) JP  
特願 2004-019616 2004 年 1 月 28 日 (28.01.2004) JP  
特願 2004-253894 2004 年 9 月 1 日 (01.09.2004) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山岡 徹 (YAMAOKA, Tohru). 小倉 洋 (OGURA, Hiroshi). 三由 裕一 (MIYOSHI, Yuichi). 佐々木 智幸 (SASAKI, Tomoyuki).

- (74) 代理人: 前田 弘, 外 (MAEDA, Hiroshi et al.); 〒5410053 大阪府大阪市中央区本町 2 丁目 5 番 7 号 大阪丸紅ビル Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

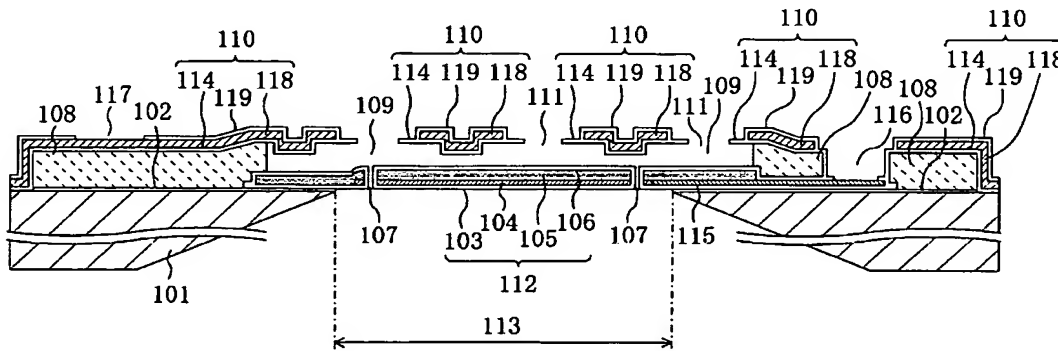
添付公開書類:

- 国際調査報告書  
— 補正書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ELECTRET AND ELECTRET CAPACITOR

(54) 発明の名称: エレクトレット及びエレクトレットコンデンサー



(57) Abstract: A silicon nitride film (103) and another silicon nitride film (106) are so formed as to cover a charged silicon oxide film (105) which is to be an electret.

(57) 要約: エレクトレットとなる帯電したシリコン酸化膜 105 を覆うようにシリコン窒化膜 103 及びシリコン窒化膜 106 が形成されている。